

11月1日～ 使用規程改定に伴う 試料作製装置 記録簿の記入方法変更のお知らせ

11月より、以下の試料作製装置についても使用料を頂戴することになりました。

研磨・薄片化装置 (予約必要：ひと枠(4時間) 1,000円)

- ・ P I P S II M-695
- ・ T E M M I L L Model 1050
- ・ N a n o M I L L Model 1040
- ・ イオンスライサ EM-09100IS

コーティング装置 (予約不要：1回 500円)

- ・ イオンコーター JFC-1600 (1スパッタあたり)
- ・ カーボンコーター EC 32010CC (1カーボン芯あたり)

各装置の記録簿に課題申請者名と、財源コードを記入する欄を設けましたので、そのつど記入してください。

PIPS II 使用記録簿 Use track records

※コードが不明の場合は、事務室で確認してください

日付 Date	予約枠 Frame	課題申請者 Project leader	財源コード Budget code	使用者 User name	試料 Sample	稼働時間(h) Use time	電圧値 Voltage (keV)	電流値Current(μA)		真空度 Vacuume(Pa)	備考 Remarks
								Gun left	Gun right		
11/1	1・②・3	松村 晶	HAXU0001	電野 太郎	Fe	1h	0.3	30	26	6×10^{-3}	
/	1・②・3										
/	1・2・3										
/	1・2・3										
/	1・2・3										

※課題申請されたコードをお知りになりたい場合は、センター事務室で確認をお願いします。

ご不明な点は事務室までお問い合わせください。